

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11)特許番号

特許第3232963号 (P3232963)

(45)発行日 平成13年11月26日(2001.11.26)

(24)登録日 平成13年9月21日(2001.9.21)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ		
B 2 3 K	35/26	3 1 0	B 2 3 K	35/26	3 1 0 A
	35/22	3 1 0		35/22	3 1 0 A
H05K	3/34	507	H05K	3/34	507C
		5 1 2			5 1 2 C

請求項の数12(全 7 頁)

(21)出願番号	特顧平7-203054	(73)特許権者	000005108
			株式会社日立製作所
(22)出願日	平成7年8月9日(1995.8.9)		東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地
		(72)発明者	中塚 哲也
(65)公開番号	特開平8-164495		神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地株
(43)公開日	平成8年6月25日(1996.6.25)		式会社日立製作所生産技術研究所内
審查請求日	平成11年9月10日(1999.9.10)	(72)発明者	曾我 太佐男
(31)優先権主張番号	特顧平6-245048		神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地株
(32)優先日	平成6年10月11日(1994.10.11)		式会社日立製作所生産技術研究所内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者	下川 英恵
			神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地株
			式会社日立製作所生産技術研究所内
		(74)代理人	100075096
			弁理士 作田 康夫
		審査官	鈴木 毅
			最終質に続く
		11	•

(54)【発明の名称】 有機基板接続用鉛レスはんだ及びそれを用いた実装品

1

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】電子部品と基板を接続するためのはんだで あって、該はんだの組成はZn:3~5%, Bi:10 ~23%, 残りSnであることを特徴とするはんだ。

【請求項2】電子部品と基板を接続するための3元系は んだであって、該はんだの組成(Sn. Zn. Bi)は、A(8 5,5,10),B(72,5,23), C(76,3,21)で囲まれた範囲にあ ることを特徴とするはんだ。

【請求項3】請求項1または2亿記載のはんだであっ て、該はんだの液相線温度が195℃以下で固相線温度が1 10 て、該基板がプリント基板であることを特徴とする実装 60℃以上であることを特徴とするはんだ。

【請求項4】請求項1から3のいずれか1項に記載のは んだの組成に Inを 1~5%含有させたことを特徴とす るはんだ。

【請求項5】請求項1から4のいずれか1項に記載のは

んだであって、該はんだがペースト状であることを特徴 とするはんだ。

【請求項6】請求項1から5のいずれかに1項に記載の はんだを用いて、基板と電子部品を接続したことを特徴 とする実装品。

【請求項7】請求項1から5のいずれかに1項に記載の はんだを用いて、電子部品を基板に実装したことを特徴 とする実装品。

【請求項8】請求項6または7に記載の実装品であっ

【請求項9】請求項6または7に記載の実装品であっ て、該基板がガラスエポキシ基板であることを特徴とす る実装品。

【請求項10】請求項6または7に記載の実装品であっ

20

3

て、該基板がガラスポリイミド基板、ガラス繊維基材ビスマレイド・トリアジン基板およびセラミック基板のいずれか1つであることを特徴とする実装品。

【請求項11】リード付き電子部品と、銅配線を有する有機基板と、該電子部品と該有機基板の該銅配線を電気的に接続するはんだを有する実装品であって、該はんだが請求項1から5のいずれか1項に記載のはんだであることを特徴とする実装品。

【請求項12】請求項5に記載のはんだを基板にベースト印刷する工程と、該基板の電極と電子部品の端子が電 10気的に接続するように該半導体装置を該基板に搭載する工程と、該はんだをリフローする工程とを有することを特徴とする実装品の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ガラスエポキシ基板に LSI, 部品等を接続するために、最高温度220~2 30℃でのはんだ付けが可能で、かつ150℃の高温で も機械的強度面で十分な信頼性を有するPbレスはんだ 及びそれを用いた実装品に関するものである。

[0002]

【従来の技術】一般に使用されているプリント基板材質はガラスエポキシ製である。ガラスエポキシ基板の耐熱温度はリフロー炉を用いた場合、最高 $220 \sim 230$ $^{\circ}$ である。これに使用する接続用はんだは、Pb-63% Sn 共晶はんだ(融点:183°C)、若しくは共晶近傍のはんだ組成が使用されており、融点は <math>183°C前後であるため、汎用されているガラスエポキシ基板の耐熱温度 (230°C)以内で十分な接続がなされてきた。また、高温での信頼性は最高 150°Cまで保証できた。

【0003】最近、米国では電子部品に使用されている プリント基板がのざらしに放置され、このはんだに含ま れる鉛(以下、Pbと記す) は酸と容易に反応して(酸性 雨等でも加速される)地下水に溶けることが公表されて いる。そこで、Pbに代わるPbレスはんだ合金とし て、環境への影響が少なく、資源の涸渇の問題が少な く、コスト面での問題も少なく、材料としての使用実績 がある、Sn、Zn、Bi等が有力候補としてクローズ アップされている。既に2元系はんだでは5n-3.5 %Ag(融点221℃), Sn-5%Sb(融点240 ℃)はPbレスはんだとして使用実績がある。しかし、 融点が髙過ぎるためガラスエポキシ基板のはんだ付け用 には使用できない。Sn-9%Zn(融点199℃の共 晶) は融点は下がるが、表面が著しく酸化されやすく、 CuもしくはNiに対するぬれ性がSn-Ag系、Sn - Sb系に比べ著しく低下するため、また融点的にもガ ラスエポキシ基板に電子部品を220~230℃でリフ ローできる程低い融点ではない。これまでの実績ではは んだの融点に対して、はんだ付け温度は30~50℃高 4

n共晶はんだ(融点: 183℃)の場合,炉リフローの最高温度は220℃が標準である。この温度差は37℃である。短時間にはんだ付けできるウェーブソルダリングの場合,235℃が標準である。この温度差は52℃である。ぬれ性の悪い場合は更にこの温度差は大きくなる。Sn-9%Znはんだを用いた場合,一般に使用しているロジン系のフラックス(塩素0.2%含有)を用いても、230℃のリフロー温度ではほとんどぬれないことが分かっている。

【0004】他方、Sn-Bi系はんだ(代表組成Sn-58%Bi; 融点138℃),Sn-In系はんだ(代表組成Sn-52%In; 融点117℃)があるが、固相線温度が下がるため150℃の高温強度を保証できない。従ってこれらの組成はP.b-63%Sn共晶はんだ代替用のはんだと言えるものではない。このため、新たな組合せでの要求を満たす新はんだ材料の開発が要求されている。

【0005】主成分としてSn-Zn-Biの3元系は んだは融点の面から有望である。Sn-Zn-Bi系は んだは特願昭55-87627,特願昭58-6201 7で権利化されている。

【0006】特願昭55-87627号公報によると、 Znが5~10%, Biが8~13%, 残部がSnから なる耐食性に優れた低融点Al用はんだを提案してい る。低温で強度向上を目的とした A 1 用はんだであり、 Cu導体からなるプリント基板を接続の対象としていな い。また、2nが5%以上であることから酸化が著し く、かつ、酸化膜が強固なため、電子部品接続に一般に 使用されている弱いフラックス(ロジン系)では還元でき 30 ない。従って、強いフラックスの使用が必須である。こ のような強いフラックスの使用は電子部品の接続には、 フラックス残渣による腐食が問題になる。例えば、コネ クターピンの接続の時、コネクター内部に入ったフラッ クスは洗浄で除去できず、残渣となり導体部を腐食させ る原因となる。従って、通常はパッケージの状態では 0.2%までの塩素が入ったフラックスが使用されてき た。これ以上強いフラックスを使用すると、洗浄しきれ ない場合のフラックス残渣による腐食、マイグレーショ ンの問題、電気絶縁特性の劣化等の問題が生じやすく、 使用を避けているのが実情である。

で)はPbレスはんだとして使用実績がある。しかし、
融点が高過ぎるためガラスエポキシ基板のはんだ付け用
には使用できない。Sn-9%Zn (融点199 Cの共
晶)は融点は下がるが,表面が著しく酸化されやすく、
CuもしくはNiに対するぬれ性がSn-Ag 系、Sn-Sb 系に比べ著しく低下するため,また融点的にもガ
ラスエポキシ基板に電子部品を $220\sim230$ でリフ
ローできる程低い融点ではない。これまでの実績ではは
んだの融点に対して,はんだ付け温度は $30\sim50$ Cであ
いのが経験的に知られている。例えば,Pb-63%S
50 (0007) 特願昭58-62017 号公報によると,
Znが $5\sim15\%$, $Biが3\sim20\%$, 残部がSn か
なるはんだ合金を提案されており,ワイヤの接続におけ
る強度向上を目的としている。また,実施例の融点は高
く、ガラスエポキシ基板の耐熱温度に耐えられる230
で以内でリフローできるはんだ組成とは言えない。ま
た、Zn が5%以上であることから酸化が著しく,か
つ、酸化膜が強固なため,電子部品接続に一般に使用さ
れている弱いフラックスの使用が必須である。このよう

5

な強いフラックスの使用は電子部品の接続には、フラッ クス残渣による腐食、電気絶縁特性の劣化等が問題にな るため使用できない。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】本発明はPbを用いな いで、Pb-Sn共晶はんだの代替用はんだを用いて、 従来の基板にLSI、部品等の電子部品を高信頼で実装 するため、230℃以下で、かつ弱いフラックスでCu 導体上、もしくは部品のSn系はんだめっき端子構成で ている。このため、融点は固相線温度が少なくとも16 0℃以上, 望ましくは170℃以上(150℃の高温で の使用に耐えられることも必要条件)であり、液相線温 度が最高195℃以下、望ましくは190℃以下(高く することははんだ付け温度が高くなり、基板、部品に対 する熱影響が大きくなる)とすることを第一課題とし た。ぬれ性確保には端子へのメタライズでカバーできる が、材料自体の物性によるぬれの悪さを防止するため、 ぬれの悪いZnの量を最小限に押さえる必要がある。し かし2nを入れないことには液相線温度が大きく下がら ないので、ぬれとのバランスを保って組成を決める必要 がある。SnにZnを9%入れた状態で199℃の最小 値になるが、前述した通りこれでは未だ融点が高く、ぬ れが悪過ぎる。

[0009]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、Pbレスはんだの組合せの中で、環境への影響が少 なく、資源の枯渇の問題がなく、融点を下げることがで きて、ぬれ性を確保できるSn-Zn-Biの3元系は んだをベースとした合金を候補として検討した。この3 30 元系はんだの状態図の詳細は未知で、図1に示されるよ うに、融点(液相線温度)の概略が分かる程度である。と のため、融点(固相線温度、液相線温度)と組成との関 係、組成とぬれ性、物性、機械的特性等の関係等を明ら かにする必要があった。本発明の基板接続用はんだは、 Znが3~5%, Biが10~23%, 残部がSnのS n-Zn-Bi系をベースとした合金、あるいはこの合 金にIn, Ag, Sb, Cuのうち1種または2種以上 の元素を添加してぬれ性、機械的性質を良くしたことを 特徴とするものである。

[0010]

【作用】はんだ組成を上記に限定した理由は次の通りで

【0011】Znが3%以下では液相線温度が高いた め、230℃以下での接続が困難である。5%以上では はんだの表面酸化が激しいため、電子部品はんだ付けと して実績のあるフラックスを用いたのではぬれ性を確保 できない。このため、低温化が可能な材料で、かつ、環 境、資源、実績、コスト等の面で優れるBiを第三元素 として添加することで、融点を目標とする温度域に近付 50

けることとした。Sn-Znの2元共晶線は、Biが1 1~23%の範囲では、Znが4~5%の間を通ること から、2元共晶線から外れることは液相線と固相線の温 度差が大きくなり、接続に望ましい状態とはいえない。 また乙nが3~5%の範囲ならば、乙nの酸化の影響を それほど受けないのでぬれ性もある程度確保できる。か つ、ガラスエポキシ基板への電子部品を実装できる融 点、ぬれ性の組成を見出せられる。

【0012】Biが10%以下では液相線温度が200 十分にぬれ性を確保し、リフローできることを目的とし 10 ℃以上であるため、220~230℃でのリフロー接続 が困難となる。 Biが23%以上では固相線温度が15 0℃近くに下がること及びはんだ自体に延性がなくな る。従って、髙温での信頼性のマージン確保が困難であ り、機械的特性も低下する。-55~150℃の温度サ イクル加速試験に耐えられるには、固相線温度としては 低くても160°C以上が必要である。

[0013]

【実施例】以下、本発明を実施例によりさらに詳細に説 明する。

【 0 0 1 4 】表 1 に本発明におけるS n - Z n - B i 系 はんだの検討した組成の固相線温度及び液相線温度を示 す。なお、融点(液相線、固相線温度)は2°C/minの 昇温速度でDSCを用いて測定した。得られたDSCカ ーブより液相線, 固相線温度は図2に示されるようにカ ーブのピークからそれぞれ高温部、低温部に向かって引 いた接線がカーブの平らな部分の延長線と交わる点の温 度とした。

[0015]

【表 1 】

40

【表1】

組成(mass%)	液相線温度(℃)	固相線温度(℃)
Sn-3Zn-10Bi	207	175
Sn-3Zn-11Bi	208	173
Sn-3Zn-13Bi	203	171
Sn-3Zn-15Bi	202	168
Sn-3Zn-17Bi	198	165
Sn-3Zn-19Bi	195	164
Sn-3Zn-22Bi	191	160
Sn-3Zn-23Bi	190	159
Sn-3Zn-25Bi	187	155
Sn-4Zn-13Bi	197	173
Sn-4Zn-15Bi	195	170
Sn-4Zn-17Bi	194	166
Sn-4Zn-19Bi	190	165
Sn-4Zn-22Bi	185	161
Sn-4Zn-23Bi	184	159
Sn-4Zn-24Bi	183	134
Sn-5Zn-10Bi	195	179
Sn-5Zn-11Bi	194	178
Sn-5Zn-13Bi	194	172
Sn-5Zn-16Bi	193	170
Sn-5Zn-17Bi	189	169
Sn-5Zn-19Bi	186	165
Sn-5Zn-23Bi	181	160
Sn-5Zn-25Bi	179	136
Sn-1Zn-24Bi	203	

(4)

10

30

3

【0016】図1はSn-Zn-Biの3元系はんだの 公知の状態図 [International Critical Tables.2(192 7),418) である。全体の概略的な融点(液相線温度)は分 かるが、その液相面ですら正確な形状等は分かっていな いのが実状である。すなわち,液相線温度と固相線温度 との関係は不明である。そこで、必要とする融点域に絞 った組成の液相線温度及び固相線温度を調べたのがそれ ぞれ図3, 4である。図3は図2の範囲を拡大し、液相 線温度を表示したものである。熱分析曲線からSn-Ζ n系の2元共晶ライン(太線で流れを示した)の谷はBi 量が11~23%の範囲では、2nが4~5%の範囲を 通過していることが分かった。Bi量の下限として、1 0%以下では2元共晶ラインの谷の液相線温度が195 ℃以上になることから、ガラスエポキシ基板を対象とす るはんだ付けは困難のため、Bi量は10%以上とし た。図4は図3と同じ組成範囲の固相線温度を表示した ものである。図4の括弧の中の値は液相線温度(図3参 照)と固相線温度との温度差を示す。一般的に接続にお いては、温度差は少ないのが望ましいとされている。固 相線温度はBiが少ない範囲では要求範囲に入っている が、Bi量が23%以上になると160℃を切ることが 分かった。また、Bi量が24%以上で固相温度が13 0℃近くまで降下してしまう点が存在することがわかっ た。これは、Bi量が24%以上になると、融点の低い Sn-Zn-Bi3元系共晶組成に近い組成をもつ相が 析出するためと考える。従って、Biの上限は23%と した。図2、3、4から分かるように、2n量の変化に よる融点の変化は著しく、 Znが3%以下ではBiが少 ない範囲で(16%以下)液相線温度は200℃以上を超 えてしまう。また、乙nが3%以下ではBi量を問わ ず、液相線温度と固相線温度との温度差がついてくる (図4)ので、接続の観点から望ましくない。 Znが3% ではBiが25%以下でも液相線温度は187℃以下で あることから、融点の条件として187℃以下である必 要から Z n が 3 %以上であることが必要条件である。他 方、 乙n が5%以上になると、液相線温度と固相線温度 との温度差は少なくなるので、接続の観点からは望まし い。しかし、Znの酸化が著しくなり、ぬれ性が悪くな る弊害が大きく、電子部品接続用として実用的ではな い。また、融点的にみても、Znが5%以上では2元共 晶ラインの谷を超えているので,液相温度が上昇してい く方向であり、 乙nが3~5%のはんだに比べてメリッ トのある組成とは言えない。更には、Cuとの合金層の 成長が大になり、脆くなるため2nは5%以下が望まし い。このため、これとして3~5%を妥当な範囲とし た。以上は融点、はんだ付け条件から検討した結果であ るが、ぬれ性の面から検討した結果、酸化度の状態に比 例してぬれ性も低下することが分かった。 すなはち、 乙 n量の増加と共にぬれ性は低下する。これより、ぬれ性 の点ではZn量は少ない程良い。

【0017】図5は縦軸に温度を取り、横軸にBi含有 量(mass%)を取り、液相線温度と固相線温度との関係を 示した。液相線温度と固相線温度との差は一般的には少 ない程望ましい。この差がつき過ぎると接続プロセス上 での問題が出やすい。はんだ付け最高温度は220~2 30℃と決められているので、液相線温度と固相線温度 との差がないほど高温での信頼性のマージンが広がるこ とになる。この図から、 Zn量が3,4,5%における液 相線温度と固相線温度との関係が分かる。固相線温度は Biが23%近くまではZn量にあまり依存せずBi量 の増加に伴って下降していくことがわかる。しかし、2 3%を過ぎると急激に固相線温度が低下する傾向があ る。固相線温度が160℃を切らないBi量はZn量が 3~5%の範囲では23%以下の範囲である。液相線温 度もBi量の増加に伴い下降していくが、Zn量にも大 きく依存しており、 乙n量が3,4,5%と増加するにつ れ、液相線温度は下がり、液相線温度と固相線温度の差 は小さくなる。図5に示されてはいないが、2元共晶ラ インの直線部分はZn量4%と5%の間を通ることが熱 分析結果によって明らかとなったので、 乙n量を4%と 5%の間のある値(5%に近い)にすれば、液相線温度は Zn量が3,4,5%のときよりも低下し、液相線温度と 固相線温度の差はさらに小さくなり接続の観点から望ま しい状況となることがわかる。Zn量が少ないと継手の 強度は小さくなるが、電子部品継手の信頼性の点からは 強度向上を余り必要としていないのが実状である〔例え ば 曽我:はんだ付け継手の信頼性、ブリント回路学会 誌, Vol.7, No.2 (1992)]。Sn-Zn-Bi系はん だの一般的性質は、高温での強度(耐クリーブ性等)が強 く、かつ、耐熱疲労性にも優れており、バランスの良い はんだである。

【0018】次に、最高220℃のリフロー温度で、ブリント基板のCu端子に対するはんだのぬれ性を評価した。使用したフラックスは0.2%の塩素が入ったロジン系である。Zn量が多い程ぬれ性は低下していることが分かった。また、同様に、Bi量によるぬれ性の影響を調べると、Bi量が多くなるほどぬれ性は低下してくる。しかし、Zn量の変化程には敏感ではないことが分かった。これより、ぬれ性は、Zn量に大きく依存し、Znが5%以下で十分ではないが、接続に必要なぬれが得られる結果を得た。

【0019】図6は横軸にZn量、縦軸にBi量を取り、液相線(195℃,190℃,185℃)、固相線(160℃,165℃,170℃)をパラメータにしたものである。液相線温度と固相線温度の等温ラインは交叉する特殊なケースと考えられる。交点の組成における液相線温度を上段に、固相線温度を下段に示した。液相線温度は220℃ではんだ付けする必要から高くとも195℃以下にし、固相線温度は150℃の高温での信頼性を確保するため、低くとも160℃以上にする必要がある。Zn量は多いとぬれ性の低下

をもたらし、酸化が激しいことから、5%以下とする。 また, B i 量は23%以上ではさらに低温の融点(13 0℃)をもつ新たな3元共晶組織があらわれ、かつ脆く なり、伸びが低下するため継手として良くない。従っ て、これらを含む組成範囲として、A (85,5,10), B (72, 5,23),C (76,3,21)で囲まれた組成範囲を適正領域と決 めた。

【0020】AB(Zn:5%)と液相線(1)と固相線 (6)で囲まれた領域はZn5%以内で液相線195℃以 下, 固相線160℃以上を満たす組成が得られる。AB と液相線(2)と固相線(5)で囲まれた領域はZn5%以 内で液相線190℃以下、固相線165℃以上を満たす 組成が得られる。同様にABと液相線(3)と固相線(5) で囲まれた領域はZn5%以内で液相線185℃以下, 固相線165℃以上を満たす組成が得られる。この中で 液相線温度が185℃前後で、固相線温度が165℃以 上で、かつBi量を少なくした組成としてZn4.5-Sn76.5-Ві19が考えられる。この組成につい てのぬれ性、強度等の検討を行った。

【0021】ガラスエポキシ基板のCuパッド上に厚さ 10μmのSnめっきを施したサンプルに, 上記組成の はんだを直径約50μmのボールに作成しペースト化し たものを、印刷により各パッド上に供給した。ペースト には若干強めのフラックスを用い、約180μmの厚さ に印刷した。その上にQFP-LSI(0.5mmピッ チ)を搭載した。LSIの42アロイリードにはSnめ っきが8 µm施されている。230℃でリフローすると とによりSn表面の酸化膜はフラックス中の塩素により 還元されてはんだがぬれ拡がる。なお、Snめっきの代 わりにSn-Biめっきを施すことにより融点を下げ、 ぬれ拡がりを増すことができる。はんだめっき厚さは1 0 μ m以下であることから、全体の組成変化による融点 の影響は少ない。また、Cuバッド上に薄くNi-Au めっきを施し、そして42アロイリード上に同様にNi -Auめっきを施すことにより表面は酸化されにくいた め、はんだ表面の酸化膜が破られさえすればぬれ拡がり に優れる構成をとることができる。

【0022】Sn76.5-Zn4.5-Bi19組成 (液相線温度185℃, 固相線温度165℃)のペースト 用はんだボール(平均50μm径)に2μmのSnめっき 40 (もしくはSn-Biめっき)を施した。このように表面 処理すると、はんだ付け直前の165℃で内部のはんだ が溶け始め、Snめっきは内部のはんだに溶け初める。 185℃になると溶解し、表面のSn(もしくはSn-Bi)ははんだ中に完全に溶けると同時に、 隣接のはん だボールと溶触する。この時、表面にZnの成分も出て 来るが、N₂雰囲気であるためZnが酸化されないた め、フラックス中での基板パッド、部品端子上のぬれ性 を確保できる。基板パッド、部品の端子上のSnめっき のSn〇、膜はフラックス中の塩酸で還元され、最高2

30℃の温度でリフローが可能となる。基板及び部品の 端子上のSn量はペースト中のはんだ量と比較して少な いので、成分的にはSn含有量が1%程度増えるだけで ある。従って、最終的はんだ組成の融点は、ペーストは んだの融点とほとんど変わらない。そして、はんだ付け にはフラックスの存在とN、雰囲気でのリフローのた め、Znの酸化を防止でき、Sn-Zn-Biのリフロ ーにおける端子上への十分なぬれ性を確保できた。比較

的液相線温度及び固相線温度の高いSn84-Zn5-

10

BillはんだにInを3%添加し、液相線温度及び固 相線温度を下げた組成をペースト用として使用した。表 面は2nの酸化を防止するため5nめっきを2~5μm 施した。従ってN,雰囲気のリフロー中で固相線温度を 超えた170℃で内部のはんだと溶融を開始し、185 ℃で完全に溶融が完了すると共に、Znの成分はN,の ため酸化せず、230°Cの最高温度で容易にはんだは端 子上にぬれ拡がることを確認した。

[0023]

【発明の効果】 以上のように、本発明のSn-Ζn-Bi系はんだは、環境を考慮し、資源的に安定して供給 可能で涸渇の問題がなく、コスト高にならず、かつ、従 来のPb-Sn共晶はんだと同等のリフロー温度で従来 から使用されている基板に、同一のリフロー装置ではん だ付けできる。本はんだは強度が強く、特に髙温での強 度、耐クリープ強度に優れる。電子部品の継手としても 従来のPb-Sn共晶はんだと比べ同等の耐熱疲労性を 有するものである。

【0024】本発明はガラスエポキシ基板を対象にした が、それ以上の耐熱性基板、例えばガラスポリイミド基 板、BT(ガラス布基材ビスマレイド・トリアジン)基 板、セラミック基板等に使用できることは言うまでもな

【図面の簡単な説明】

50

【図1】公知となっているSn-Zn-Bi 3元系状 態図(液相線温度)である。

【図2】DSCカーブを用いた融点(液相線, 固相線温 度)解析法を示す図である。

【図3】熱分析によって明らかとなった 乙n:3~5 %, Bi:10~25%の範囲内の液相線温度を示す図 である。

【図4】熱分析によって明らかとなった Zn:3~5 %, Bi:10~25%の範囲内の固相線温度を示す図 である。

【図5】各2n含有量のはんだ合金について横軸にBi 含有量、縦軸に温度をとり液相線温度と固相線温度の関 係を示す図である。

【図6】横軸に含有Zn量、縦軸に含有Bi量をとった 図面上に液相線温度と固相線温度のデータを響き入れ、 請求項3,請求項4の特許請求範囲を示した図である。 【符号の説明】

(6)

特許3232963

11

- (1)Sn-Zn2元共晶ライン
- (2)液相線温度195℃
- (3)液相線温度190℃
- (4)液相線温度185℃

* (5)固相線温度170℃

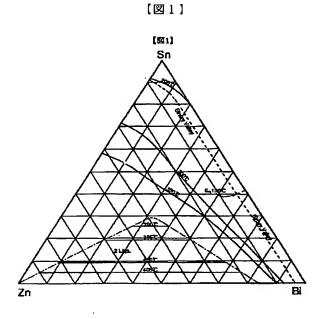
(6)固相線温度165℃

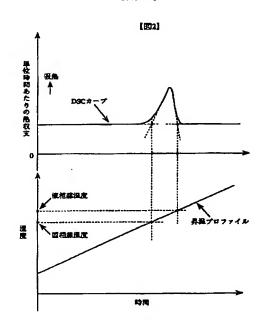
(7)固相線温度160℃

*

【図2】

12

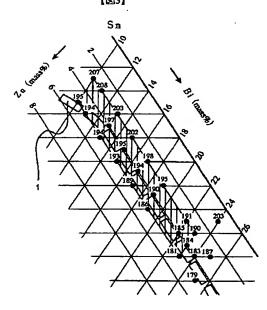




【図3】

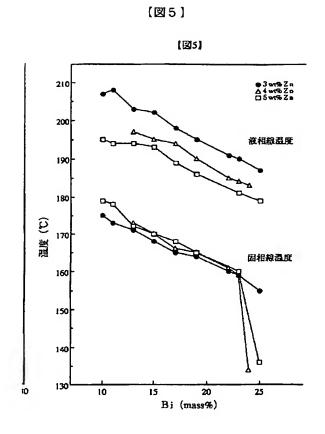
【図3】

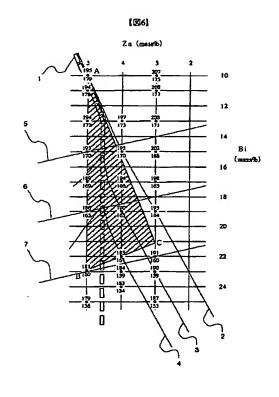
【図4】



| (回4) | Sn | 173(32) | 173(35) | 173(15) | 173(35) | 173(15) | 173(35) | 173(15) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) | 173(25) |

BEST AVAILABLE COPY





【図6】

フロントページの続き

(72) 発明者 山本 健一

東京都小平市上水本町五丁目20番1号株

式会社日立製作所半導体事業部内

(72)発明者 原田 正英

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地株

式会社日立製作所生産技術研究所内

(72)発明者 落合 雄二

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地株

式会社日立製作所生産技術研究所内

(72)発明者 亀井 常彰

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地株

式会社日立製作所生産技術研究所内

(56)参考文献 特開 平8-192291 (JP, A)

特開 平8-150493 (JP, A)

特開 平3-128192 (JP, A)

特開 平7-51883 (JP, A)

特公 昭48-39693 (JP. B1)

(58)調査した分野(Int.Cl.', DB名)

B23K 35/22 - 35/26

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **08164495** A

(43) Date of publication of application: 25.06.96

(51) Int. CI

B23K 35/26

B23K 35/14

B23K 35/22

H05K 3/34

H05K 3/34

(21) Application number: 07203054

(22) Date of filing: 09.08.95

(30) Priority:

11.10.94 JP 06245048

(71) Applicant:

HITACHI LTD

(72) Inventor:

NAKATSUKA TETSUYA SOGA TASAO

SHIMOKAWA HIDEYOSHI YAMAMOTO KENICHI HARADA MASAHIDE OCHIAI YUJI

KAMEI TSUNEAKI

(54) LEADLESS SOLDER FOR CONNECTING ORGANIC SUBSTRATE, AND MOUNTED SUBSTRATE USING IT

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide a leadless solder capable of soldering at the maximum temperature, and having the sufficient reliability in the mechanical strength aspect even at high temperature, and a mounted substrate using it to connect the LSI, parts, etc., on a glass epoxy substrate.

CONSTITUTION: The first leadless solder for connecting the glass epoxy substrate has the composition consisting of 3-5% Zn, 10-23% Bi, and the balance Sn, and the mounted substrate using it is provided. The second leadless solder for connecting the glass epoxy substrate has the composition (Sn, Zn, Bi) surrounded by A(85, 5, 10), B(72, 5, 23), and C(76, 3, 21), and the mounted substrate using it is provided. Soldering can be achieved on the glass epoxy substrate which has been conventionally used at the same reflow temperature as that of the conventional Pb-Sn eutectic solder by the solder which is environmentally friendly, inexpensive

and available for stable supply in terms of resources.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO

